

# Fiche d'application n° 77

## Profilométrie XPS avec source GCIB

**Objet :** Identification, séparation de couches nanométriques et multicouches obtenues par plasma atmosphérique sur PET

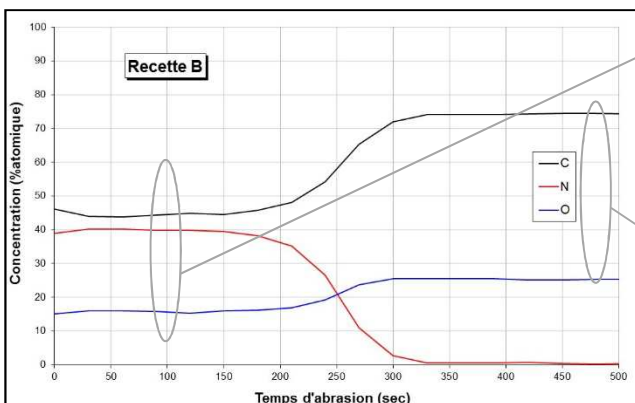
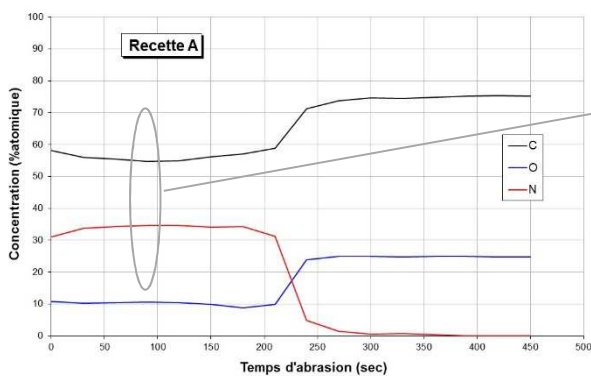
**Technique mise en œuvre :** XPS + GCIB

- ✓ GCIB : Gas Clusters Ion Beam
- ✓ Profil quantitatif de répartition en profondeur de couches organiques pour étude des formes chimiques

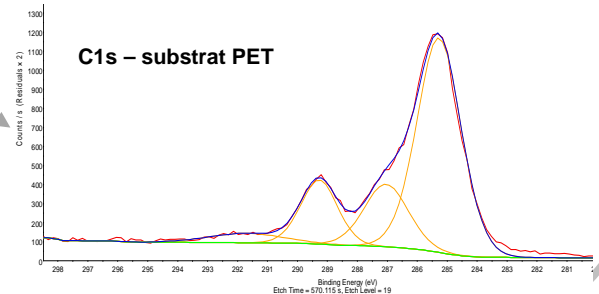
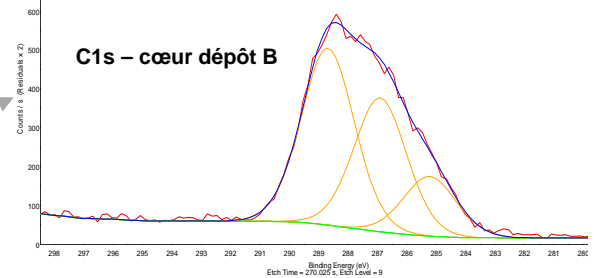
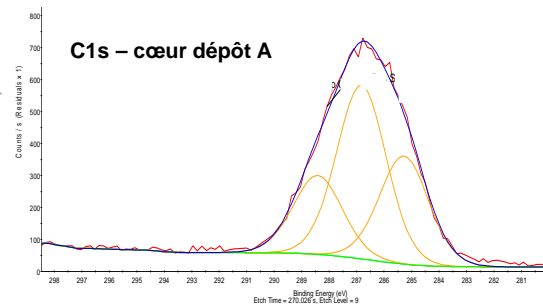
### Résultats :



#### 1. Profil quantitatif de répartition en profondeur



#### 2. Formes chimiques du carbone



### Conclusion :

Utilisation d'une source à clusters d'argon, pour le profilage de revêtements polymère, sans dégradation permettant l'obtention de profils quantitatifs à haute résolution en profondeur et la détermination des formes chimiques à cœur du nanodépôt.